

Presseinformation

Dresden, 07. November 2011

Fraunhofer CNT unterzeichnet gemeinsames Entwicklungsrahmenabkommen mit großem Ausrüstungszulieferer

Fraunhofer CNT gab heute die Unterzeichnung eines gemeinsamen Entwicklungsabkommen mit ASM International N.V. (ASM) bekannt. Die Vereinbarung umfasst eine Vielzahl neuer Projekte im Verlauf der nächsten fünf Jahre.

Das Fraunhofer CNT und ASM werden dabei neue Prozess- und Integrationsmethoden entwickeln und mit ASM's Advance® Serie A412 300 mm vertikal Stapelofen beginnen, der sowohl für die atomare Schichtabscheidung (ALD) als auch für die chemische Niederdruckdampfabscheidung (LPCVD) konfiguriert ist. Das Fraunhofer CNT wird Räumlichkeiten, Infrastruktur und seinen Reinraum für das A412-System zur Verfügung stellen. Ziele des ersten Projektes sind die Entwicklung und Integration neuer Stapel-ALD Prozesse und Materialien für den Einsatz in der komplementären Metall-Oxid-Halbleiter (CMOS)-Logik-Technologie.

Neben den 40 Reinraum-Tools bringen die Wissenschaftler am Fraunhofer CNT umfangreiche Erfahrungen in der Prozess- und Materialcharakterisierung, sowie der Charakterisierung von Nanoelektronikgeräten mit ein. Vorprozessierte Test- oder Produktwafer werden von ASM oder ihren Kunden zur Verfügung gestellt und am Fraunhofer CNT unter strengen Kreuzkontaminationsanforderungen, die durch jahrelange Kooperation mit führenden Chipherstellern entwickelt wurden, prozessiert. Dadurch können die Ergebnisse unmittelbar in der Produktion angewendet werden, wodurch unsere Partner Kosten- und Entwicklungszeitersparnisse generieren können.

Prof. Peter Kücher, Leiter des Fraunhofer CNT erklärte: „Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit bei der Entwicklung innovativer und kostengünstiger Prozesse für CVD und ALD, mit einem der weltweit führenden Ausrüster wie ASM“.

Ivo Raaijmakers, Chef der Technologieabteilung bei ASM fügte hinzu: „Wir haben über 5 Jahre erfolgreich mit CNT zusammengearbeitet und sind zuversichtlich, dass dieser neue kooperative F&E-Rahmen weitere erfolgreiche Projekte ermöglichen wird.“

Über Fraunhofer-Center für Nanoelektronische Technologien (CNT)

Das Fraunhofer CNT, welches am 31. Mai 2005 eröffnet wurde, ist ein Beispiel für die enge Zusammenarbeit zwischen Forschung und Produktion, für die Dresden hervorragende Bedingungen aufweist. Aufgrund seiner günstigen Lage innerhalb des "Silicon Saxony", bieten sich ideale Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen und Material / Ausrüstung Hersteller auf dem Gebiet der Nanoelektronik.

Innerhalb der ehemaligen Räumlichkeiten von Infineon gibt es einen Reinraum (Reinraumklasse 1000) von ca. 800 m² für die Forschung des Fraunhofer CNT sowie eine Infrastruktur, die dem Industriestandard entspricht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung von speziellen Prozessschritten für die Fertigung von High-Density-Speicher-Chips sowie High-Performance-Transistoren. Darüber hinaus arbeitet das Fraunhofer CNT an der Entwicklung neuer analytischer Methoden und Messtechniken sowie an der Analyse der Wafer-Verarbeitung für die zahlreiche Labors zur Verfügung stehen.

www.cnt.fraunhofer.de